

固体材料気化供給装置 AcroStar®

株式会社 高純度化学研究所 は、長年に渡る薄膜形成用材料の製造・開発・研究の経験を活かし、CVD/ALD用 液体および、固体 Precursor を提供してまいりました。特に近年では、炭素、有機分子を含まない“カーボンニュートラル”無機固体材料が注目されています。

これらの有機基を含まない無機固体材料は、蒸気圧が低く気化温度が高温のものが多く、顧客様がお持ちの薄膜形成用 CVD/ALD装置に Precursor を一定量安定的にガス化導入する昇華・気化供給システムのご要望をいただき、固体材料気化供給装置 “AcroStar®”を開発いたしました。

薄膜形成用材料の供給メーカーがお届けする固体材料気化供給システムにどうぞ期待ください。

AcroStar® の主な特徴

1. プロセス加熱温度 150°C 200°C に対応した配管系機材・バルブ類をご提案
2. Parallel Switchable Line: 連続運転用装置とSingle Line: 実験・試作用装置をご用意
3. 材料メーカーが 固体PRECURSOR の供給に最適な気化装置をご提案
4. 顧客様の成膜装置毎にカスタマイズ

顧客様保有 成膜装置に対応

AcroStar®
固体材料昇華
供給装置

CVD / ALD
顧客様保有
成膜装置



カーボンフリー
無水
無機固体
成膜原料
KJC-SP材料

AcroStar® 操作パネル



Main Menu



Auto Mode→

Manual Mode→



Parameter Setting



Alarm History

Auto Mode
Interrupt
Processing→

